

## 英語セッションのご案内

以下のセッションでは英語による講演が予定されています。

6.4 薄膜新材料		
3/19(水) 9:00~18:30	口頭講演	D6会場(D棟 209)
3/20(木) 13:00~15:00	口頭講演	D6会場(D棟 209)
10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)		
3/17(月) 10:00~10:25	ショートプレゼンテーション	E7会場(E棟 201)
3/17(月) 13:30~15:30	ポスター講演	PA会場(アリーナ)
3/17(月) 15:45~17:30	口頭講演	E7会場(E棟 201)
3/18(火) 9:00~11:45	口頭講演	E7会場(E棟 201)
10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術		
3/17(月) 10:26~11:06	ショートプレゼンテーション	E7会場(E棟 201)
3/17(月) 13:30~15:30	ポスター講演	PA会場(アリーナ)
3/19(水) 9:00~14:00	口頭講演	E7会場(E棟 201)
10.3 GMR・TMR・磁気記録技術		
3/17(月) 11:06~11:18	ショートプレゼンテーション	E7会場(E棟 201)
3/17(月) 13:30~15:30	ポスター講演	PA会場(アリーナ)
3/20(木) 9:00~15:00	口頭講演	E7会場(E棟 201)
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス		
3/17(月) 11:18~11:52	ショートプレゼンテーション	E7会場(E棟 201)
3/17(月) 13:30~15:30	ポスター講演	PA会場(アリーナ)
3/19(水) 14:00~18:30	口頭講演	E7会場(E棟 201)
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス		
3/17(月) 11:18~11:52	ショートプレゼンテーション	E7会場(E棟 201)
13.5 Si-English Session		
3/19(水) 16:00~18:00	ポスター講演	PG会場(G棟2階)
3/20(木) 9:00~12:30	口頭講演	F10会場(F棟 406)
シンポジウム "Flexible Electronics"		
3/18(火) 9:00~16:30	口頭講演	D9会場(D棟 315)
シンポジウム "Developments and Challenges for Resistance Change Memories Technology"		
3/18(火) 9:00~18:30	口頭講演	E1会場(E棟 101)